

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第6部門第1区分

【発行日】平成19年7月19日(2007.7.19)

【公開番号】特開2006-17497(P2006-17497A)

【公開日】平成18年1月19日(2006.1.19)

【年通号数】公開・登録公報2006-003

【出願番号】特願2004-193428(P2004-193428)

【国際特許分類】

G 0 1 N 33/49 (2006.01)

G 0 1 N 33/48 (2006.01)

【F I】

G 0 1 N 33/49 Y

G 0 1 N 33/48 M

【手続補正書】

【提出日】平成19年6月4日(2007.6.4)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

分析物から第1のパラメータに関する第1測定データおよび第2のパラメータに関する第2測定データを取得する測定データ取得手段と、

前記第1および第2測定データに基づいて、前記第1および第2のパラメータを軸とし、分析物に含まれる有形成分の分布を示す2次元分布図を作成する2次元分布図作成手段と、

前記2次元分布図上に分画領域を設定する領域設定手段と、

前記領域設定手段によって設定された前記分画領域に属する有形成分について、前記第1のパラメータを軸とする度数分布図を作成する度数分布図作成手段と、

前記2次元分布図および前記度数分布図を出力する出力手段と、を備える分析装置。

【請求項2】

前記出力手段は、前記2次元分布図と前記度数分布図とを同一画面上に表示する請求項1記載の分析装置。

【請求項3】

前記領域設定手段によって複数の分画領域が設定された場合に、前記度数分布図を作成する前記分画領域を前記複数の分画領域の中から選択する領域選択手段をさらに備える請求項1または2に記載の分析装置。

【請求項4】

前記領域選択手段は、複数の分画領域を選択可能である請求項3記載の分析装置。

【請求項5】

前記度数分布図作成手段は、前記2次元分布図に属する全ての有形成分の度数分布図をさらに作成する請求項1～4のいずれか1項に記載の分析装置。

【請求項6】

前記2次元分布図は、前記有形成分の分布位置によって異なる色を使用して前記有形成分が表現される分布図であり、前記度数分布図は、前記分画領域に属する有形成分が单一の色を使用して表現される分布図である請求項1～5のいずれか1項に記載の分析装置。

【請求項7】

前記領域設定手段によって設定された前記分画領域に属する有形成分の統計データを算出する統計データ算出手段をさらに備える請求項1～6のいずれか1項に記載の分析装置。

【請求項8】

前記出力手段は、ディスプレイであり、

前記ディスプレイに表示されるポインタを移動させるためのポインティングデバイスをさらに備え、

前記分画領域は、前記ポインティングデバイスを用いて前記ポインタを前記ディスプレイ上で移動させることによって変更される請求項1～7のいずれか1項に記載の分析装置。

【請求項9】

分析物から第1のパラメータに関する第1測定データ、第2のパラメータに関する第2測定データおよび第3のパラメータに関する第3測定データを取得する測定データ取得手段と、

前記第1、第2および第3のパラメータを軸とし、分析物に含まれる有形成分の分布を示す3次元分布図を作成する3次元分布図作成手段と、

前記3次元分布図上に分画領域を変更可能に設定する領域設定手段と、

前記領域設定手段によって設定された前記分画領域に属する有形成分について、前記第1および第2のパラメータを軸とする2次元分布図および前記第1のパラメータを軸とする度数分布図の少なくとも一方を作成する参考用分布図作成手段と、を備える分析装置。

【請求項10】

分析物に含まれる有形成分の分布を示す2次元分布図上に設定された分画領域に属する有形成分について、一次元の度数分布図を作成する度数分布図作成手段を備える分析装置。

【請求項11】

分析物に含まれる有形成分の分布を示す2次元分布図上に設定された分画領域に属する有形成分について、一次元の度数分布図を作成する工程をコンピュータに実行させる分析プログラム。

【請求項12】

分析物に含まれる有形成分の分布を示す2次元分布図上に設定された分画領域に属する有形成分について、一次元の度数分布図を作成する工程を備える分画領域設定方法。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】発明の名称

【補正方法】変更

【補正の内容】

【発明の名称】分析装置、分析プログラム、分画領域設定方法

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0001

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0001】

本発明は、分析装置、分析プログラム及び分画領域設定方法に関し、さらに詳しくは、分画領域を適切に設定することができる分析装置、分析プログラム及び分画領域設定方法に関する。

【手続補正4】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0005

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0005】

本発明の分析装置は、分析物から第1のパラメータに関する第1測定データおよび第2のパラメータに関する第2測定データを取得する測定データ取得手段と、前記第1および第2のパラメータを軸とし、分析物に含まれる有形成分の分布を示す2次元分布図を作成する2次元分布図作成手段と、前記2次元分布図上に分画領域を設定する領域設定手段と、前記領域設定手段によって設定された前記分画領域に属する有形成分について、前記第1のパラメータを軸とする度数分布図を作成する度数分布図作成手段と、前記2次元分布図および前記度数分布図を出力する出力手段とを備える。